OPTICAL PICKUP SYSTEM

Publication number: JP2004039062

Publication date:

2004-02-05

Inventor:

HATAZAWA KENJI

Applicant:

SHARP KK

Classification:

- international:

G11B7/135; G11B7/125; G11B7/135; G11B7/125;

(IPC1-7): G11B7/135; G11B7/125

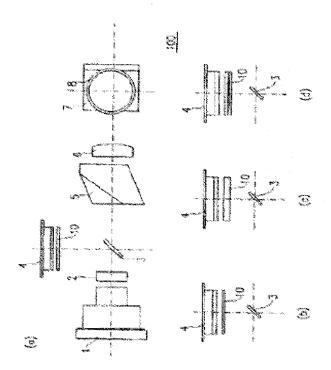
- European:

Application number: JP20020192708 20020701 Priority number(s): JP20020192708 20020701

Report a data error here

Abstract of JP2004039062

PROBLEM TO BE SOLVED: To precisely control the laser power of an optical pickup by simply and precisely adjusting the light amount of the laser beam entering a front monitor. SOLUTION: The optical pickup has a laser beam source 1, an optical system to focus the light beam on on an optical disk 9, a front monitor 4 to detect the laser power by monitoring part of the light beam, and a control system to control the laser power depending on the result detected by the front monitor. A filter 10 with an adjusted light transmissivity is disposed between the front monitor 4 and the laser beam source 1 to adjust the light amount of the light beam entering the front monitor 4. COPYRIGHT: (C)2004,JPO



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

3
臣
整
K
69

(13)公開特許公報(N)

(11) 特許出願公則番号 特開2004-39062

(P2004-39062A)

	2004. 2. 5)	
, , ,	平成16年2月5日(20	
	(43) 公開日	

١.						
	IH			テーマコード	下 (参表)	_
		7/135	2	5D119		
G11B 7/125	G11B	7/125	U	5D789		
		審査請求 未請求	未開水 請求項の数 11	数 11 OL		(全 14 頁)
(21) 出願番号	特頭2002-192708 (P2002-192708)	(71) 出願人	000005049			
(22) 出願日	平成14年7月1日 (2002.7.1)		ツャーン株式会社	ᆏ		
		(74) 代理人	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 100078282	陪野区夷池町	22番	2 2 本
			Ħ	秀策		
		(74) 代理人	100062409			
			弁理士 安村	高明		
		(74) 代理人	100107489			
			弁理士 大塩	竹志		
		(72) 発明者	金 編 第二			
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号	倍野区長池町	22番	224
			シャープ株式会社内	会社内		
		Fターム(参考)	₹) 5D119 AA43	BA01 EC09	FA23	FA34
			HA13	HA36 JA57	JA63	
			5D789 AA43	BA01 EC09	FA23	FA34
			HA13	HA36 JA57	JA63	

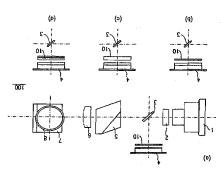
(54) [発明の名称] 光ピックアップ装置

[57] [要約]

【課題】フロントモニターに入射される光ビームの光量 を高精度、かつ、容易に調整して、光ビックアップ装置 のレーザーパワーを高精度に削御する。

「解決手段」レーザー光源1と、光ビームを光ディスク 9に集光照射する光学系と、光ビームの一部をモニター してレーザーパワーを検出するフロントモニター4と、 フロントモニターの検出結果に基づいてレーザーパワー を制御する制御系とを備えた光ピックアップ装置におい て、フロントモニター4とレーザー光源1との間に、フ ロントモニター4に入射される光ビームの光量を調整す るために、光透過率が調整されたフィルター10が配置 メカイいる

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターレてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの検出結果に基づいて該レーザー光源の彫動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装置において、

あったものであって、数フィルターの光透数フロントモニターとレーザー光源との間にフィルターが配置され、数フィルターの光透過率によって、数フロントモニターに入射される光ビームの光量が調整されている光ビックアップ装置。

[請求項2]

レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターレてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの検出結果に基づいて該レーザー光源の影動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装置において、

該フロントモニダーとレーザー光顔との間に、該光ビームの一部を反射してフロントモニターに入射させるマイクロミラーが配置され、該マイクロミラー表面の光反射率によって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調整されている光ビックアップ装置

來項3】

レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する 光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターレてレーザーパワーを検出するフロントモニターの検出結果に基づいて該レーザー光原の駆動制御を行う制御系とを構えた光ピックアップ装置において、

建小佰//

前記マイクロミラー表面または前記フロントモニター受光部表面に、該マイクロミラー表面の光反射率または該フロントモニター受光部表面の光透過率を調整するための皮膜が設けられている請求項2または請求項3に記載の光ピックアップ装置。

報中個の

前記マイクロミラー表面または前記フロントモニター受光部表面に、部分的な皮膜が設けられ、皮膜形成部分と皮膜非形成部分との面積比率によって、該マイクロミラー表面の光反射率または該フロントモニター受光部表面の光透過率が調整されている請求項2または請靠項3に記載の光ビックアップ装置。

【請求項6】

前記マイクロミラー表面または前記フロントモニター受光部表面に設けられた皮膜は,前 記フロントモニターに入射される光ビームの光量に応じて着色されている請求項4または 請求項5に記載の光ビックアップ装置。

【請求項7】

レーザー光源と、鼓レーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターレてレーザーパワーを検出するフロントモニターと検出結果に基づいて 該レーザー光原の隔動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装置において、

抜フロントモニターとレーザー光源との間に集光レンズが配置され、該集光レンズの配置位置によって、該フロントモニターに入射されるレーザー光の光量が調整されている光ビックアップ装置。

【請求項8】

ソーザー光源と、該ソーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該ソーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターしてレーザーパワー

(4)

特開2004-39062(P2004-39062A)

を検出するフロントモニターと、該フロントモニターの検出結果に基づいて該レーザー光 **塀の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装置において、**

荻薄板状先端部に光が照射されるように配置され、該薄板状先端部の配置角度および配置 高さによって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調整されている光ピッ 抜フロントモニターとレーザー光源との間に、その先端部が薄板状に形成されたビスが、

ノーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する を検出するフロントモニターと、該フロントモニターの検出結果に基づいて該レーザー光 光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターしてレーザーパワー 原の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装置において、 **抜フロントモニターとレーザー光源との間にアパーチャーが配置され、該アパーチャーの** 開口形状および配置位置によって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調 整されている光ピックアップ装置。

【請求項10】

レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビームを情報記録媒体に集光照射する を検出するフロントモニターと、該フロントモニターの検出結果に基づいて該レーザー光 光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一部をモニターしてレーザーパワー 源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装置において、

該フロントモニターとレーザー光源との間に接着剤注入部が設けられ、該接着剤注入部か ら注入された接着剤の量によって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調 整されている光ピックアップ装置、

前記接着剤は、前記フロントモニターに入射される光ビームの光量に応じて種類が異なっ

ている請求項10に記載の光ピックアップ装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

用いられる光ピックアップ装置に関し、特に、フロントモニター方式によってレーザー光 原から出射される光ビームの光量を検出して、レーザーパワーを制御することが可能な光 本発明は、DVD、CD等の光ディスクに対して情報の読み取り・書き込みを行うために ピックアップ装置に属する。

[0002]

【従来の技術】

経年変化等によって出射されるレーザーパワーが変動する。このため、APC (Auto 従来から、光ピックアップ・装置に用いられている半導体レーザーにおいては、温度変動

Power Control)回路によりレーザーパワーを制御することによって、光 ディスク等の情報記録媒体に対して照射される光ビームのパワーレベルの安定化が図られ ている。このようなAPC回路の代表的なものとして、リアモニター方式(内部モニタ方 式)のAPC回路とフロントモニター方式(外部モニタ方式)のAPC回路とが挙げられ

[0000]

リアモニター方式は、半導体レーザーの光出射闘端面とは反対側の端面に設けられたモニ ターによって、その反対側の端面から出射された光ビームをモニターする方式であるため レーザーパワーの検出精度が低くなる等の問題がある。このため、より一般的には、フ ロントモニター方式が採用されている。フロントモニター方式は、半導体レーザーの光出 射側端面から出射される光ビームを反射ミラー等を用いて分岐し、分岐された光ビームの 一部をフロントモニターによってモニターして、モニター結果を半導体レーザーの駆動回 路にフィードバックすることによって、光ビームのパワーを一定に保つように制御する方

[0004]

図7 (a)は、フロントモニター方式の光ピックアップ装置の基本的な構造を示す上面図 であり、図7(b)は図7(a)の側面図である。

[0005]

2、フーザー光源 1 から出射 むれる光 バームの一部をモニターしてレーザーパワーを検出 1から出射される光ビームをDVD、CD等の光ディスク9に集光照射するための光学系 するフロントモニター4と、フロントモニター4の検出結果に基づいてレーザー光源1の この光ピックアップ装置700は、半導体レーザー等のレーザー光源1と、レーザー光源 駆動制御を行う制御系とによって構成されている。

(9000)

トラッキングサーボに用いられる副ビームとに分離され、反射ミラー3及びビームスプリ この光ピックアップ装置700において、レーザー光源1から出射されたレーザー光は、 回折格子2によって回折されて光ディスク9から記録情報を読み取るための主ビームと、 ッタ5に入射される。

[0001]

れ、立上ミラー7によって反射されて対物レンズ8に入射され、光ディスク9に集光照射 ビームスプリッター5に入射された光ビームは、コリメートレンズ6によって平行光とさ される。

[8000]

るレーザーパワーが一定に保たれるようになっている。なお、この図および以下の図では 光ディスク9の情報記録面によって反射された光を検出して情報を復元する検出系につ トモニター4では、入射された光によってレーザーパワーが検出される。フロントモニタ レーザー光源1に供給される電流が制御される。 これによって、光ディスク 9に入射され **一方、反射ミラー3にて反射された光ビームは、フロントモニター4に入射され、フロン** 一4によるレーザーパワーの検出結果は、図示しないフィードバック制御系に供給され、 フィードバック制御系によって、フロントモニター4の出力レベルが一定になるように、 ハては、図示および説明を省略している。

[6000]

【発明が解決しようとする課題】

る従来の光ピックアップ装置では、レーザー光源1の光放射特性、レーザー光源1から出 射された光ビームを反射させる反射ミラー3の反射率、光ピックアップ装置を構成する各 ター4の取り付け状態等がばらつくことによって、フロントモニター4に受光される光ビ 上述したようなフロントモニター方式によってレーザーパワーを一定に保つように制御す 種部材が取り付けられるハウジングに対する反射ミラー3の取り付け状態、フロントモニ --ムの光量にばらつきが発生する。

[0010]

けすることによってゲイン調整を行うことができるようになっているが、量産時には、ボ クアップ装置では、ゲイン調整を行うためのボリューム抵抗を光ピックアップ装置に外付 これらのばらつきがレーザーパワーの精度に与える影響を低減するために、従来の光ピッ リューム抵抗によって調整可能な範囲を超えるようなばらつきも多い。

00111

正範囲に入れることは可能であっても、ボリューム抵抗が光ピックアップ装置の応答速度 また、外付けのボリューム抵抗によってゲイン調整を行う場合には、レーザーパワーを適 に影響を及ぼすため、個々の特性にばらつきが生じるという問題もある。

アップ装置において、CD、DVD等の光ディスクに対して情報書き込みを行う場合には レーザーパワーの制御をより高精度に行うことが必要とされるため、上記各構成部材の 特に、ノートブック型パーソナルコンピューター等に内蔵されるスリムタイプの光ピック 特性精度および取り付け精度を向上させるために、製造工程での検査を強化する必要があ り、製造歩留まり低下、コスト上昇、生産性低下等の要因になっている。

(9)

を制御可能な光ピックアップ装置が提案されている。この従来の光ピックアップ装置では 整形プリズムに入射され、その整形プリズムに設けられたARコートが施されていない反 ARコートが施されていない反射面では、光反射率は主として光の入射角によって一律に ところで、特開2000-21001号公報には、製造ばらつき、環境変動の影響などを 受けにくく、信頼性が高いフロントモニター方式のAPC回路を用いて、レーザーパワー 半導体フーザーから出射された光ビームがコリメートレンズ、グレーティングを介して **材面で光ビームの一部が反射されて、フロントモニターに入射されるようになっている。 定まるため、常に安定した光量がフロントモニターに入射されるようになる。**

前によって、レーザー光源からの光ビームの一部を反射させてフロントモニターに入射さ を防ぐためのものである。よって、レーザー光源の光放射特性、レーザー光源から出射さ り付け状態等にばらつきが生じた場合には、フロントモニターに入射される光ビームの光 しかしながら、この従来の光ピックアップ装置は、製造ばらつき、温度・湿度等の環境変 れた光ビームを反射させる反射ミラーの反射率、光ピックアップ装置を構成する各種部材 が取り付けられるハウジングに対する反射ミラーの取り付け状態、フロントモニターの取 せる反射膜(例えば図7に示す反射ミラー3)の反射率・透過率等の特性が変動すること 量を調整してレーザーパワーの検出精度を向上させることができない。 本発明は、このような従来技術の課題を解決するためになざれたものであり、フロントモ ニターに入射される光ビームの光量を高精度、かつ、容易に調整して、レーザーパワーを 高精度に制御することができる光ピックアップ装置を提供することを目的とする。 [0016]

【課題を解決するための手段】

部をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの **ルターの光透過率によって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調整され** ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 険出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 置において、該フロントモニターとレーザー光源との間にフィルターが配置され、該フィ **本発明の光ピックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー** そのことにより上記目的が達成される。

部をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの フロントモニターに入射させるマイクロミラーが配置され、該マイクロミラー表面の光反 ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 険出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 射率によって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調整され、そのことに 本発明の光ビックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー 置において、該フロントモニターとレーザー光源との間に、該光ビームの一部を反射して より上記目的が達成される。

[0018]

郑をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの 検出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 置において、該フロントモニター受光部表面の光透過率によって、該フロントモニターに 本発明の光ピックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 入射される光ビームの光量が調整され、そのことにより上記目的が達成される。

[0019]

クロミラー表面の光反射率または該フロントモニター受光部表面の光透過率を調整するた 好ましくは、前記マイクロミラー表面または前記フロントモニター受光部表面に、該マイ めの皮膜が設けられている。

な皮膜が設けられ、皮膜形成部分と皮膜非形成部分との面積比率によって、該マイクロミ **仔ましくは、前記マイクロミラ―表面または前記フロントモニター受光都表面に、部分的** ラー表面の光反射率または該フロントモニター受光部表面の光透過率が調整されている。 **守ましくは、前記マイクロミラー表面または前記フロントモニター受光部表面に設けられ** と皮膜は、前記フロントモニターに入射される光ビームの光量に応じて着色されている。

郷をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの 険出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 置において、該フロントモニターとレーザー光源との間に集光レンズが配置され、該集光 本発明の光ピックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー レンズの配置位置によって、該フロントモニターに入射されるレーザー光の光量が調整さ ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 れ、そのことにより上記目的が達成される。

部をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの 険出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 置において、該フロントモニターとレーザー光源との間に、その先端部が薄板状に形成さ れたビスが、該薄板状先端部に光が照射されるように配置され、該薄板状先端部の配置角 **支および配置高さによって、該フロントモニターに入射される光ビームの光量が調整され** 本発明の光ピックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 そのことにより上記目的が達成される。

険出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 **卵をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの** 置において、該フロントモニターとレーザー光源との間にアパーチャーが配置され、該ア パーチャーの開口形状および配置位置によって、該フロントモニターに入射される光ビー 本発明の光ピックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 ムの光量が調整され、そのことにより上記目的が達成される。

険出結果に基づいて該レーザー光源の駆動制御を行う制御系とを備えた光ピックアップ装 部をモニターしてレーザーパワーを検出するフロントモニターと、該フロントモニターの 置において、該フロントモニターとレーザー光源との間に接着剤注入部が設けられ、該接 着剤注入部から注入された接着剤の量によって、該フロントモニターに入射される光ビー 本発明の光ピックアップ装置は、レーザー光源と、該レーザー光源から出射される光ビー ムを情報記録媒体に集光照射する光学系と、該レーザー光源から出射される光ビームの一 ムの光量が調整され、そのことにより上記目的が達成される。

[0026]

好ましくは、前記接着剤は、前記フロントモニターに入射される光ビームの光量に応じて 種類が異なっている。

0.027

以下に、本発明の作用について説明する。

[0028]

ビス、アパーチャー、接着剤等を設けることによって、フロントモニターに入射される 本発明にあっては、フロントモニターとレーザー光源との間に、フィルター、集光レンズ

光ビームの光量を調整することができる。また、フロントモニター受光部表面の光透過率 、またはフロントモニターとレーザー光源との間に設けられるマイクロミラー(反射ミラ (8

一)表面の反射率を調整することによって、

フロントモニターに入射される光ビームの光量を調整することができる。

特に、レーザー光源とフロントモニターとの間に配設される各種部材を、主として適正な レーザーパワーの設計上のセンター値よりも高めになるように設計しておくことによって フロントモニターに入射される光ビームの光量を低下させて、容易に調整することがで

[0630]

このように、フロントモニターとレーザー光源との間に光量を調整する機構を設けること DVD等の光ディスクに対する情報の読み取り・情報の書き込みの精度を向上させること によって、レーザーパワーをより高精度に制御することが可能となり、その結果、CD、

[0031]

【発明の実施の形態】

以下に、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。なお、以下の図におい て、図7に示す従来の光ピックアップ装置と同じ機能を有する部分については、同じ符号 を付している。

[0032]

(実施形態1)

図1(a)は、本発明の一実施形態であるフロントモニター方式の光ピックアップ装置1 00の構成を示す上面図である。

[0033]

するフロントモニター4と、フロントモニター4の検出結果に基づいてレーザー光源1の 1から出射される光ビームをDVD、CD等の光ディスク9に集光照射するための光学系 と、レーザー光源1から出射される光ビームの一部をモニターしてレーザーパワーを検出 この光ピックアップ装置100は、半導体レーザー等のレーザー光源1と、レーザー光源 駆動制御を行う制御系とによって構成されている。

って平行光とされ、立上ミラー7によって反射されて対物レンズ8に入射され、光ディス って反射さる。ビームスブリッター5に入射された光ビームは、コリメートレンズ6によ 可析格子2によって回折されて光ディスク9から記録情報を読み取るための主ビームと、 トラッキングサーボに用いられる副ビームとに分離され、その一部は、反射ミラー3によ この光ピックアップ装置100において、レーザー光源1から出射されたレーザー光は、 ク9に集光照射される。

カレベルが一定になるように、レーザー光源1に供給される電流が制御される。これによ ミラー3によって反射された光ビームは、フィルター10を介してフロントモニター4に パワーが検出され、図示しないフィードバック制御系によって、フロントモニター4の出 反射ミラー3とフロントモニター4との間には、フィルター10が配置されており、反射 入射されるようになっている。フロントモニター4では、入射された光によってレーザー って、光ディスク9に入射されるレーザーパワーが一定に保たれるようになっている。 [0036]

図1(b) \sim (d)は、図1(a)の反射ミラー3、フィルター10およびフロントモニ ター4部分の一例を示す図である。

[0037]

0が配置されており、フィルター10の光透過量を調整することによって、フロントモニ 図1(b)では、反射ミラー3とフロントモニター4との間に、厚みが薄いフィルター1 ター4に入射される光ビームの光量を少し減らすことができる。

また、図1(c)では、反射ミラー3とフロントモニター4との間に、厚みが厚いフィル

ター10が配置されており、フィルター10の光透過量が図1(b)に比べて少なくなる ため、フロントモニター4に入射される光ビームの光量をさらに減らすことができる。

[0039]

-10が積層配置されており、2枚のフィルター10の光透過量によって、フロントモニ さらに、図1(d)では、反射ミラー3とフロントモニター4との間に、2枚のフィルタ ター4に入射される光ビームの光量を減らすことができる。

量を調整することができるため、レーザー光源1の光放射特性、レーザー光源1から出射 **邹材が取り付けられるハウジングに対する反射ミラー3の取り付け状態、フロントモニタ** このように、反射ミラー3とフロントモニター4との間に配置されるフィルター10の村 された光ビームを反射させる反射ミラー3の反射率、光ピックアップ装置を構成する各種 賞、厚み、枚数を調整することによって、フロントモニター4に入射される光ビームの光 **ー4の取り付け状態等がばらつくことによって、フロントモニター4に受光される光ビー** ムの光量に広範囲のばらつきが発生しても、容易に調整することができる

(実施形態2)

示す上面図であり、図2(b)~(d)は、反射ミラー3およびフロントモニター4部分 図2 (a) は、本実施形態のフロントモニター方式の光ピックアップ装置200の構成を の一風を示す図である。

は、、速乾性の樹脂が直接塗布されている。 皮膜3 aの光反射率を調整して反射ミラー3の 図2(b)では、反射ミラー3の表面およびフロントモニター4の受光部表面の透明樹脂 **米反射率を調整し、皮膜4aの光透過率を調整してフロントモニター4の受光部表面の光** 透過率を調整することによって、フロントモニター4に入射される光ビームの光量を減ら すことができる。 なお、反射ミラー3の表面およびフロントモニター4の受光部表面の透 明樹脂のいずれか一方に皮膜を形成するようにしてもよい。

左半分の領域だけに樹脂が塗布されて皮膜4.aが形成されており、右半分には樹脂が塗布 されていない。このように皮膜4aが形成されている領域と形成されていない領域との面 また、図2(c)では、フロントモニター4の受光部表面の透明樹脂に対して、図に示す **寛比率を調整することによって、フロントモニター4の受光部表面の光透過率を調整して** フロントモニター4に入射される光ビームの光量を調整することができる。

[0044]

よって、反射ミラー3表面の光反射率を調整して、フロントモニター4に入射される光ビ さらに、図2(d)では、反射ミラー3表面に対して、図に示す下半分の領域だけに樹脂 に皮膜3aの形成されている領域と形成されていない領域との面積比率を調整することに が塗布されて皮膜3aが形成されており、上半分には樹脂が塗布されていない。このよう ームの光量を調整することができる。

[0045]

ター4の取り付け状態等がばらつくことによって、フロントモニター4に受光される光ビ このように、反射ミラー3表面またはフロントモニター4の受光部表面に設けられる皮膜 の材質、形成領域を調整することによって、フロントモニター4に入射される光ビームの 光量を調整することができるため、レーザー光源1の光放射特性、レーザー光源1から出 射された光ビームを反射させる反射ミラー3の反射率、光ピックアップ装置を構成する各 蟹部材が取り付けられるハウジングに対する反射ミラー3の取り付け状態、フロントモニ **-ムの光量に広範囲のばらつきが発生しても、容易に調整することができる。**

このような皮膜3aおよび4aは、部品取り付け後でも、簡単な作業により容易に形成す ることができる。また、調整レベルに応じて、塗布される樹脂の色を変えることによって 光ピックアップ、装置の量産時にレベルに応じた調整・管理を容易に行うことができる。

[0047]

(実施形態3)

図3は、本実施形態のフロントモニター方式の光ピックアップ装置300の構成を示す上面図である。

[0048]

この光ピックアップ装置300は、反射ミラー3とフロントモニター4との間に、集光レ

ンズ11が配置されている。

[0049]

この集光レンズ11の配置位置を反射ミラーとフロントモニター4との間で調整することによって、フロントモニター4に入射される光ビームの光量を調整することができるため、レーザー光源1の光放射特性、レーザー光源1から出射された光ビームを反射させる反射・ジラー3の反射率、光ビックアップ装置を構成する各種部材が取り付けられるハウジングに対する反射ミラー3の取り付け状態、フロントモニター4の取り付け状態等がばらっくことによって、フロントモニター4に受光される光ビームの光量に広範囲のばらつきが発生しても、容易に調整することができる。

[0600]

(実施形態4)

図4(a)は、木実施形態のフロントモニター方式の光ピックアップ装置400の構成を 示す上面図である。

[0051]

よってアップップ装置400は、反射ミラー3とフロントモニター4との間に、調整ビス(または調整ビン)12が配置されている。

[0052]

図4(b)は、図4(a)の調整ビス12の一例を示す側面図であり、図4(c)は、調整ビス12の回転角度と遮光鏡域との関係を説明するための図である。

[0053]

この調整ビス12は、ハウジング13に取り付けられており、調整ビス12の先端部12aは薄板形状に整形されている。

[0054]

この調整ビス12は、先端部12aによってフロントモニター4に入射される光を遮光することができるため、図4(b)に示すように、調整ビス12の先端部12aの高さを調整することによって、遮光領域の面積を調整してフロントモニター4に入射される光量を調整することができる。例えば、調整ビス12を浅く挿入して先端部12aの高さを高くした場合には、遮光領域が小さくなり、調整ビス12を深く挿入して先端部12aの高さを高さを高くした場合には、遮光領域が小さくなり、調整ビス12を深く挿入して先端部12aの高さを高く

[0055]

また、区々(こ)に示すように、調整ビス12の先端部12aの回転角度を調整することによって、選光領域の面積を調整してフロントモニター4に入射される光量を調整することができる。例えば、回転角度が0。では調整ビス12の薄板形状の先端部12aが光ビームの進行方向と平行になるため、選光領域は小さくなり、同転角度が90。では調整ビス12の海板形状の先端部12aが光ビームの進行方向と直角になるため、選光領域は大きくなり。

[0056]

このように、反射ミラー3とフロントモニター4との間に配置された調整ピス (または調整ピン) 12の回転角度、高さを調整することによって、フロントモニター4に入射される光ビームの光重を調整することができるため、レーザー光源 1の光放射特性、レーザー光源 1から出射された光ビームを反射させる反射・ラー3の反射率、光ビックアップ装置を構成する各種部付が取り付けられるハウジングに対する反射・ラー3の取り付け状態、フロントモニター4の取り付け状態等がばらっくことによって、フロントモニター4に受光される光ビームの光量に広範囲のばらっきが発生しても、容易に調整することができる

[0057]

(実施形態5)

図5(a)は、本実施形態のフロントモニター方式の光ピックアップ装置500の構成を

示す上面図である。

【0058】 この光ピックアップ装置500は、反射ミラー3とフロントモニター4との間に、アパー

チャー 1 4が配置されている。

【0059】 図5(b)および(c)は、アパーチャー14の一例を示す図である。

[0900]

図5(b)では、小さな開口部148を有するアパーチャー14分設けられており、選光部(本体部)が大きいため、フロントモニター4に入射される光ビームの光量を大幅に減らすことができる。

00611

また、図5(c)では、大きな開口部14aを有するアパーチャー14が設けられており、図5(b)に比べて道光部(本体部)が小さいため、フロントモニター4に入射される光ビームの光量の減少量が図5(b)に比べて少なくなる。

[0062]

さらに、同じ大きさの開口都148を有するアパーチャー14であっても、その配置位置を反射ミラーとフロントモニター4との間で左右又は回転調整することによってフロントモニター受光部に対し、アパーチャー開口面積を調整でき、フロントモニター4に入射される光ビームの光量を調整することができる。

[0063]

このように、反射ミラー3とフロントモニター4との間に設けられるアパーチャーの開口部を状、配置位置を調整することによって、フロントモニター4に入射される光ビームの光量を調整することができるため、レーザー光源1の光放射特性、レーザー光源1から出射された光ビームを反射させる反射ミラー3の反射率、光ビックアップ装置を構成する各種部材が取り付けられるハウジングに対する反射ミラー3の取り付け状態、フロントモニター4の取り付け状態等がばらつくことによって、フロントモニター4に受光される光ビームの光量に広範囲のばらつきが発生しても、容易に調整することができる。

0064

(実施形態6)

図6(a)は、本実施形態のフロントモニター方式の光ピックアップ装置600の構成を示す上面図である。

0065

この光ピックアップ装置600は、ハウジング13に、反射ミラー3とフロントモニター4との間に樹脂(接着剤)を注入するための樹脂注入口13aが設けられている。

[9900]

図6(b)~図6(c)は、樹脂注入口13aから反射ミラー3とフロントモニター4との間に樹脂を注入する工程を説明するための断面図である。

[0067]

図6(b)に示すようにハウジング13に設けられた樹脂注入口13aから、図6(c)に示すように樹脂(接着剤)15を注入する。この樹脂を硬化させることによって、図6(d)に示すように選光網15が形成され、フロントモニター4に入射される光が選光され、光量が調整される。

[0068]

接着剤としては、UV硬化タイプのものを使用することによって、瞬間的に硬化させることが可能である。また、樹脂注入口13aの大きさ、注入量を制御することによって遮光部15の面積を調整して、フロントモニター4に入射される光量を調整することができる

このように、反射ミラー3とフロントモニター4との間に設けた樹脂注入口13aから樹 から出射された光ビームを反射させる反射ミラー3の反射率、光ビックアップ装置を構成 脂を注入して遮光部15を形成することによって、フロントモニター4に入射される光ビ する各種部材が取り付けられるハウジングに対する反射ミラー3の取り付け状態、フロン トモニター4の取り付け状態等がばらつくことによって、フロントモニター4に受光され **- ムの光量を調整することができるため、レーザー光源1の光放射特性、レーザー光源1** 5光ビームの光量に広範囲のばらつきが発生しても、容易に調整することができる。

[0000]

このような遮光部15は、部品取り付け後でも、簡単な作業により容易に形成することが できる。また、調整レベルに応じて、樹脂の粘度、色を変えることによって、光ピックア ップ装置の量産時にレベルに応じた調整・管理を容易に行うことができる

[0071]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によれば、DVD、CD等の光ディスクに対して情報読み取 **判御するために設けられるフロントモニターとレーザー光源との間に、フィルター、集光** レンズ、ビス、アパーチャー、接着剤等を設けることによって、フロントモニターに入射 される光ビームの光量を調整することができる。また、フロントモニター受光部表面の光 透過率、またはフロントモニターとレーザー光源との間に設けられるマイクロミラー(反 射ミラー)表面の反射率を調整することによって、フロントモニターに入射される光ビー り・情報書き込みを行う際に用いられる光ピックアップ装置において、レーザーパワーを ムの光量を調整することができる。

[0072]

る光量を容易に理想的な光量とすることができるため、レーザーパワーをより高精度に制 脚することが可能となり、安価で高性能な光ピックアップ装置を実現することが可能とな このように、フロントモニターとレーザー光源との間に、フロントモニターに入射される 光ビームの光量を調整するための機構を設けることにより、フロントモニターに入射され

【図面の簡単な説明】

~ (d) は、反射ミラー、フィルターおよびフロントモニター部分の一例を示す側面図で **【図1】(a)は、実施形態1の光ピックアップ装置の構成を示す上面図であり、(b)**

は、反射ミラーおよびフロントモニター部分の一例を示す側面図であり、(c)は、フロ ントモニター部分の一例を示す側面図および上面図であり、(d)は、反射ミラー部分の 【図2】(a)は、実施形態2の光ピックアップ装置の構成を示す上面図であり、(b) - 例を示す側面図および上面図である。

【図3】実施形態3の光ピックアップ装置の構成を示す上面図である。

は、調整ビスの一例を示す側面図であり、(c)は、調整ビスの回転角度と遮光領域との 【図4】(a)は、実施形態4の光ピックアップ装置の構成を示す上面図であり、(b) 関係を説明するための平面図、上面図および側面図である。

【図5】(a)は、実施形態5の光ピックアップ装置の構成を示す上面図であり、(b) および(c)は、アパーチャーの一例を示す側面図および上面図である。

~ (d) は、御脂注入口から反射ミラーとフロントモニターとの間に樹脂を注入する工程 [図6] (a)は、実施形態6の光ピックアップ装置の構成を示す上面図であり、(b) を説明するための断面図である。

【図7】(a)は、従来の光ピックアップ装置の基本的な構造を示す上面図であり、(b

[符号の説明]

はその側面図である。

1 レーザー光源

回折格子

反射ミラー

フロントモニター

ビームスプリッタ

コリメートレンズ

立上ミラー 8 対物レンズ 9 光ディスク

10 71119-

集光レンズ

整形ビス 0 整形ビスの薄板形状の先端部 2 a

こセジング

スセジングの

樹脂注入口

l 3 a

アパーチャー 4

アパーチャーの照口部

接着剤(遮光部)

光ピックアップ装置 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

[図]

(図2)

